

Plasma clean system

iRP-mini

電漿清潔機 (去膠機)

富臨科技工程股份有限公司完整的提供半導體真空設備，針對太陽能光電、LED等等相關產業技術發展，所需之電漿清潔設備。

具有全自動化、大批量、製程均勻性良好與設備應用之靈活性，具有高水準的薄膜清潔處理能力，以及最低的生產設備成本的最佳競爭優勢。

真空設備的領導者

www.fulintec.com.tw

- ◆ 體積小，重量輕， all in one設計不佔空間。
- ◆ 機台使用功率小，製程氣體用量少，節能又環保。
- ◆ 整合工業電腦bar code可批次輸入，製程查詢與遠端資料存取，機台動作即時訊息顯示，操作人性化。
- ◆ 採用方型立體結構腔體，抽氣系統模組化。
- ◆ Shower head module，良好之氣場均勻分佈。
- ◆ 抽屜式載盤設計，置片操作便捷又安全。
- ◆ 機台針對LED製程應用，專機專用。
- ◆ 腔體機構簡單化設計，清潔保養簡單又快速。
- ◆ 整合式電漿源設計已獲2項台灣專利及2項大陸專利。

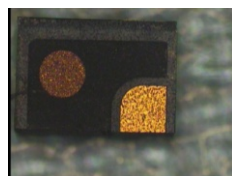
設備本體：
Width—900mm
High—1550mm
(含警示燈2000M)
Depth—780mm



Blue tape clean.



Before Treatment



After Treatment

LED chip 蒸鍍前處理



富臨科技工程股份有限公司

F.S.E. CORPORATION

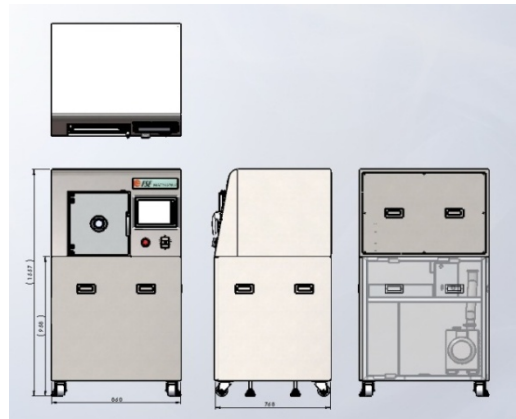
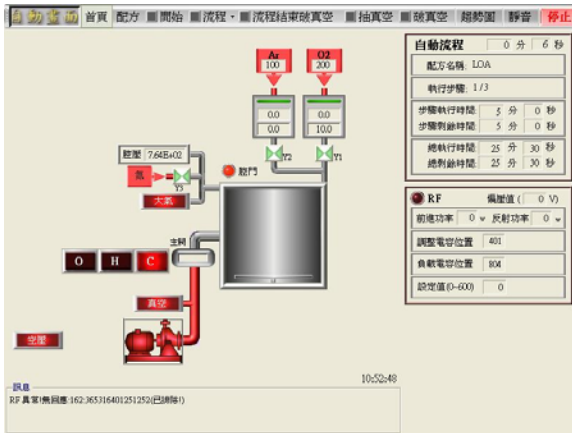
保護地球 · 永續經營

電漿清潔機 (去膠機)

LED前後段製程與封裝、LCM、IC封裝 (Flip Chip, CSP, BGA, Lead Frame etc.)、SMT、PCB、FPC、光電元件、電子元件、封裝貼合前清潔，與印刷或黏著前之表面粗化，或清潔最佳應用設備選擇。

富臨PC Base 程式特點：

- 一、VB程式撰寫+工業級TFT-LCD觸控螢幕，操作流暢動作迅速。
- 二、即時趨勢圖：可即時顯示機台壓力、功率、氣體流量等瞬時變化量。
- 三、MYSQL資料庫設計：可依不同需求查詢資料，如製程資料、設備動作資料、異常記錄，查詢迅速、範圍廣，控制程式即可達成，不需外裝其他軟體。
- 四、製程結束後資料會自動拋出至指定資料夾，可藉由Web上傳。
- 五、控制程式可另加裝遠端監控功能，以及條碼產品生產管控。



General Specifications

ITEM	SPECIFICATIONS
Outer dimension (mm)	:900(L) x 780(W) x 1550(H)
Chamber Size (mm)	:300(L) x 350(W) x 350(H)
Chamber material	:SUS304
Substrate Size	:2 inch for 80 pcs
Facilities	:3Ψ220V×60Hz×4w, 15A
Controller system	:PC base control by 10.1 touch panel
RF generator	:13.56MHz 600W
Pump Unit	:Alcatel 2033 rotary pump
Chamber vacuum	:Base Pressure:≤ 10 mTorr Leak Rate: ≤2 mTorr/min
Work pressure	:50~500mTorr
Gas Distribution	:Shower head
Mass Flow Controller	:O2 MFC 100 sccm by Area or MKS series



台北總公司

248台北縣五股鄉五股工業區五權路55號
電話：+ 886-2-2290-2333
傳真：+ 886-2-8990-4091

新竹營業所

300新竹市東光路55號7F-3
電話：+ 886-3-573-9601
傳真：+ 886-3-573-9603

台南工廠

741台南縣善化鎮樹谷園區木柵港東區21號
電話：+ 886-6-509-1507
傳真：+ 886-6-509-1569

上海分公司

富丞光電科技(上海)有限公司
上海市松江區九亭鎮運富路818號田富三期11樓
電話：+ 86-021-67627431 / 021-67627432
傳真：+ 86-21-33522904



富臨科技工程股份有限公司

F.S.E. CORPORATION

網址：http://www.fulintec.com.tw